## <sup>06</sup> Туннелирование электронов в тонкопленочных электролюминесцентных излучателях на основе ZnS: Mn

## © Н.Т. Гурин, Д.В. Рябов, О.Ю. Сабитов, А.М. Афанасьев

Ульяновский государственный университет E-mail: gurinnt@sv.ulsu.ru

## Поступило в Редакцию 4 августа 2004 г.

Методом численного моделирования экспериментальных зависимостей тока и заряда, протекающего через слой люминофора, от времени для тонкопленочных электролюминесцентных излучателей на основе ZnS: Мn с помощью расчетной временной зависимости туннельного тока электронов с поверхностных состояний прикатодной границы раздела диэлектрик-полупроводник показано, что глубина уровней поверхностных состояний изменяется в процессе роста поля от  $\sim 0.6~{\rm дo}~1.3~{\rm eV},$  вероятность туннелирования от  $10-15~{\rm do}~300-400~{\rm s}^{-1},$  ширина потенциального барьера от  $\sim 9~{\rm do}~5.7~{\rm nm}.$ 

Как известно, процесс люминесценции в тонкопленочных электролюминесцентных излучателях (ТП ЭЛИ) структуры металл-диэлектрик-полупроводник-диэлектрик-металл на основе ZnS: Mn обусловлен туннелированием носителей заряда с поверхностных состояний (ПС) прикатодной границы раздела диэлектрик-полупроводник в сильном электрическом поле, последующим лавинным размножением носителей из-за ударной ионизации собственных дефектов структуры и примесей с одновременным ударным возбуждением центров свечения Mn<sup>2+</sup> [1]. Точное описание процесса туннелирования электронов с ПС и параметров потенциального барьера на указанной границе раздела до настоящего времени отсутствует. Известные результаты моделирования данного процесса [2,3], полученные без учета умножения электронов в слое люминофора и в предположении дискретного уровня ПС с энергией  $E_t = 0.8 \,\text{eV}$  ниже дна зоны проводимости ZnS:Mn, качественно согласуются с экспериментальными данными. В [4] также на основе моделирования зависимости скорости туннельной эмиссии от поля по-

79

казано, что ПС могут быть локализованы в области энергий 0.6-0.9 eV ниже дна зоны проводимости. Автором [5] также из качественного совпадения результатов моделирования с экспериментальными зависимостями тока и напряжения от времени, действующими в ТП ЭЛИ при возбуждении ТП ЭЛИ синусоидальным напряжением, определена глубина залегания ПС  $E_t = 1.05 \text{ eV}$  с возможным разбросом от 0.9 до 1.2 eV. Авторами [6] при моделировании гистерезиса вольт-яркостной характеристики ТП ЭЛИ предполагалось равномерное распределение плотности ПС в диапазоне  $E_t$  от 0 до 2 eV с заполнением их до уровня Ферми в равновесном состоянии.

Целью работы является определение характеристик процесса туннелирования и параметров ПС на прикатодной границе раздела диэлектрик-полупроводник.

Для определения указанных характеристик и параметров используем зависимость тока, протекающего через слой люминофора, от времени  $I_p(t)$ . Как ранее нами было показано [7,8], начальный участок быстрого роста  $I_p(t)$  при возбуждении ТП ЭЛИ линейно нарастающим напряжением является экспоненциальным. При этом зависимость среднего поля в слое люминофора от времени  $F_p(t)$  на этом участке практически линейна (см. участок I на рисунке), что свидетельствует об отсутствии заметного объемного заряда в слое люминофора и однородном распределении поля в данном слое. С учетом значительного превышения падения напряжения на слое люминофора (-45-120 V) над величиной Eg/q, где Eg — ширина запрещенной зоны ZnS:Mn ( $3.7 \, eV$ ), q — заряд электрона, такое же поле  $F_p(t)$  действует в области потенциального барьера на прикатодной границе раздела диэлектрик–полупроводник.

При однородном поле в слое люминофора коэффициент ударной ионизации электронов в этом слое  $\alpha_n$  может быть представлен в виде

$$\alpha_n = \frac{1}{n_p} \frac{\partial n_p}{\partial x} = \frac{1}{n_p} \frac{\Delta n_p}{\Delta x} = \frac{1}{n_p} \frac{n_p - n_{p0}}{d_p} = \frac{1}{d_p} \left( 1 - \frac{1}{M} \right), \tag{1}$$

где  $n_{p0}$  и  $n_p$  — количество электронов, вошедших в область ударной ионизации и вышедших из этой области соответственно,  $d_p$  — толщина слоя люминофора, M — коэффициент умножения электронов,  $M = n_p/n_{p0} = \text{const.}$ 

Тогда ток, входящий в область ударной ионизации, т.е. туннельный ток электронов с ПС прикатодной границы раздела диэлектрик-полу-

проводник, равен

$$I_{p0}(t) = \frac{I_p(t)}{M} = \frac{q}{M} \frac{\partial n_p(t)}{\partial t}.$$
 (2)

С другой стороны, зависимость  $I_{p0}(t)$  может быть найдена из кинетического уравнения, описывающего туннелирование электронов с ПС через потенциальный барьер в виде

$$I_{p0}(t) = W(t) \left[ Q_{ss} - \frac{Q_p(t)}{M} \right],$$
(3)

где W(t) — вероятность туннелирования электронов в единицу времени (скорость генерации) определим с помощью оправдавшей себя применительно к излучателям на основе ZnS [5,9] формулой

$$W(t) = \frac{qF_p(t)}{2\sqrt{2m^*E_t(t)}} \exp\left[\frac{4\sqrt{2m^*E_t^{3/2}(t)}}{3q\hbar F_p(t)}\right],$$
(4)

 $Q_p(t) = \int_0^t I_p(t) dt$  — заряд, протекающий через слой люминофора,  $Q_{ss}$  — количество запасенного заряда на ПС,  $m^*$  — эффективная масса электрона,  $m^* = 0.34m_e$  для ZnS [9],  $m_e$  — масса покоя электрона,  $\hbar$  — постоянная Планка.

При этом ввиду однородного распределения поля  $F_p(t)$  в слое люминофора на участке I образованием объемного заряда за счет ударной ионизации глубоких центров, обусловленных собственными дефектами структуры [11] и, следовательно, генерацией дополнительных носителей заряда, можно пренебречь, т. е.  $M \simeq 1$ .

В дальнейшем выражения (2)–(4) использовались при численном моделировании экспериментальных зависимостей  $I_p(t)$  с одновременным использованием зависимостей  $Q_p(t)$  и  $F_p(t)$  для определения характеристик процесса туннелирования электронов  $E_p(t)$ , W(t), а также ширины потенциального барьера  $x_t(t)$  по формуле

$$x_t(t) = \frac{E_t(t)}{qF_p(t)}.$$
(5)

Экспериментальные зависимости были получены для ТП ЭЛИ, использованных в [10,11], со структурой МДПДМ, где М — нижний

прозрачный электрод на основе SnO<sub>2</sub> толщиной 0.2  $\mu$ m, нанесенный на стеклянную подложку, и верхний непрозрачный тонкопленочный электрод на основе Al толщиной 0.15  $\mu$ m, диаметром 1.5 mm; П — электролюминесцентный слой ZnS: Mn (0.5% mass.) толщиной 0.48  $\mu$ m; Д — диэлектрический слой ZrO<sub>2</sub> × Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (13% mass.) толщиной 0.17  $\mu$ m. Слой люминофора наносили вакуум-термическим испарением в квазизамкнутом объеме при температуре подложки 250°C с последующим отжигом при температуре 250°C в течение часа, непрозрачный электрод — вакуум-термическим испарением, диэлектрические слои получали электронно-лучевым испарением.

Исследования проводились при возбуждении ТП ЭЛИ знакопеременным напряжением треугольной формы в режиме однократного запуска, при котором напряжение возбуждения U(t) представляло собой пачку импульсов из двух периодов напряжения треугольной формы, следующих с частотой 20 Hz с подачей положительной или отрицательной полуволн напряжения в первом полупериоде на верхний электрод (варианты (+A1) и (-A1) соответственно). Время между однократными запусками составляло 100 s. Ток  $I_e(t)$ , протекающий через ТП ЭЛИ, измерялся аналогично [7,8,10,12].

Зависимости среднего поля в слое люминофора  $F_p(t)$ , а также тока  $I_p(t)$  и заряда  $Q_p(t)$ , протекающих через слой люминофора в режиме свечения ТП ЭЛИ, находились по методике, изложенной в [7,12], для первого полупериода напряжения U(t) при значениях емкостей диэлектрических слоев 730 рF, слоя люминофора 275 рF, определенных с помощью измерителя иммитанса E7-14 и известных геометрических размеров ТП ЭЛИ. Численное моделирование зависимостей  $I_p(t)$  проводилось с учетом ранее определенных [11] для используемых образцов ТП ЭЛИ значений  $Q_{ss} = 1.7 - 1.9 \cdot 10^{-8}$  s и при двух значениях коэффициентов умножения: M = 1 и M = 1.5 (величина, полученная в [11] при амплитудном значении напряжения U(t) = 160 V).

Из приведенных на рисунке зависимостей следует, что на начальном участке I быстрого экспоненциального роста тока  $I_p(t)$ , когда зависимость  $F_p(t)$  практически линейна (до  $t \sim 9 \,\mathrm{ms}$ ), при возрастании t или  $F_p(t)$  наблюдаются монотонный рост глубины залегания ПС  $E_t(t)$  от  $\sim 0.6$  до  $\sim 1.3 \,\mathrm{eV}$  (см. рисунок, a) (аналогичный вид имеет зависимость  $E_t(t)$  для варианта (+Al)), уменьшение ширины потенциального барьера на прикатодной границе раздела диэлектрик-полупроводник  $x_t(t)$  с  $\sim 9 \,\mathrm{дo} \sim 5.7 \,\mathrm{mm}$  для обоих вари-



Зависимости от времени: I - U(t);  $2 - I_p(t)$ ;  $3, 3' - E_t(t)$ ;  $4 - F_p(t)$ ;  $5, 5' - x_t(t)$  для варианта (-Al); 6, 6' - W(t); I — участок линейной зависимости  $F_p(t)$ , II — участок сублинейной зависимости  $F_p(t)$ ; 3, 5 - M = 1.5, 3', 5' - M = 1; 6 — вариант (-Al).



антов (±Al) (см. рисунок, *b*), а также рост вероятности туннелирования W(t) от 10 до  $300 \, \text{s}^{-1}$  для варианта (-Al) и от 15 до  $400 \, \text{s}^{-1}$  для варианта (+Al) (см. рисунок, *c*). Эти результаты, с одной стороны, согласуются с упомянутыми выше данными [2–6], а с другой стороны, свидетельствуют о более сложном характере распределения уровней ПС по энергии по сравнению с моделью дискретного уровня и с моделью равномерного распределения ПС по энергии.

Полученные результаты демонстрируют также слабое влияние изменения значений коэффициента умножения M от 1 до 1.5 на зависимости  $E_i(t), x_i(t)$ .

Следует отметить, что правомерность использования формулы (4) для определения W(t) может свидетельствовать в пользу того, что на ПС электроны связаны с нейтральными центрами [9]. Полученные данные указывают также на то, что все уровни в запрещенной зоне ZnS:Mn, соответствующие собственным дефектам структуры и имеющие глубину залегания от дна зоны проводимости  $\leq 1.3 \text{ eV}$ , такие как Zn<sup>0</sup><sub>i</sub> (0.10–0.12 eV), Zn<sup>+</sup><sub>i</sub> (0.2 eV), Vs<sup>0</sup> (0.2–1.05 eV) [8] на участке I экспоненциального роста тока  $I_p(t)$  могут быть опустошены за счет туннелирования электронов с них в зону проводимости ZnS:Mn.

Работа поддержана грантом президента РФ № НШ-1428.2003.8.

## Список литературы

- [1] Электролюминесцентные источники света / Под ред. И.К. Верещагина. М.: Энергоатомиздат, 1990. 168 с.
- [2] Bringuier E. // J. Appl. Phys. 1989. V. 66. N 3. P. 1314-1325.
- [3] Neyts K.A., De Visschere. // J.Appl. Phys. 1990. V. 68. N 8. P. 4163-4171.
- [4] Smith D.H. // J. Luminescence. 1981. V. 23. N 1. P. 209–235.
- [5] Васильченко В.П. // ЖПС. 1996. Т. 63. В. 3. С. 461–465.
- [6] Howard W.E., Sahni O., Alt M. // J. Appl. Phys. 1982. V. 53. N 1. P. 639-647.
- [7] Гурин Н.Т., Шляпин А.В., Сабитов О.Ю. // ЖТФ. 2002. Т. 72. В. 2. С. 74–83.
- [8] Гурин Н.Т., Шляпин А.В., Сабитов О.Ю. // ЖТФ. 2003. Т. 73. В. 4. С. 100–112.
- [9] Георгобиани А.Н., Пипинис П.А. Туннельные явления в люминесценции полупроводников. М.: Мир, 1994. 224 с.
- [10] Гурин Н.Т., Рябов Д.В. // Письма в ЖТФ. 2004. Т. 30. В. 9. С. 89–95.
- [11] Гурин Н.Т., Рябов Д.В. // ЖТФ. 2005. Т. 75. В. 1. С. 45–54.
- [12] Гурин Н.Т., Сабитов О.Ю., Шляпин А.В. // ЖТФ. 2001. Т. 71. В. 8. С. 48–58.